



KINTEK SOLUTION

Pacvd カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください サンプルの準備, 熱機器,
ラボ用消耗品と材料, バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

会社概要

>>> 私たちについて

Kintek Solution Ltd

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションを探求することに専念しています。および石油抽出装置。

過去20年間、当社はこの機器の再調査分野で豊富な経験を積み、お客様のニーズと現実に応じて機器とソリューションの両方を提供することができ、また、特定の作業目的に応じて多くの顧客向けの機器を開発してきました。私たちは、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中東、アフリカなど、さまざまな国の多くの大学や研究機関で多くの成功したプロジェクトを持っています。

専門性、素早い対応、勤勉さ、そして誠実さは、当社のチームメンバーの勤務態度の顕著な特徴であり、それによって当社はお客様から高い評価を得ています。

私たちはさまざまな国や地域のお客様にサービスを提供し、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーを共有する準備ができています。



液体ガス化装置付きスライド Pecvd 管状炉 Pecvd 装置

商品番号: KT-PE12



前書き

KT-PE12 スライド PECVD システム:
 広い出力範囲、プログラム可能な温度制御、スライド
 システムによる高速加熱/冷却、MFC
 質量流量制御および真空ポンプ。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-PE12-60
最大。温度	1200°C
一定の作業温度	1100°C
炉管材質	高純度クォーツ
炉管径	60mm
加熱ゾーンの長さ	1×450mm
チャンバー材質	日本製アルミナファイバー
発熱体	Cr2Al2Mo2線コイル
加熱速度	0~20°C/分
熱電対	ビルドインKタイプ
温度調節器	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1°C
摺動距離	600mm
RFプラズマユニット	
出力電力	5-500W ± 1% の安定性で調整可能
RF周波数	13.56MHz ± 0.005% の安定性
反射力	最大350W
マッチング	自動
ノイズ	
冷却	空冷。
ガス精密制御ユニット	
流量計	MFC質量流量計
ガスチャンネル	4チャンネル

流量
 MFC1: 0-5SCCM O2
 MFC2: 0-20SCCMCH4
 MFC3: 0-100SCCM H2
 MFC4: 0-500 SCCM N2

直線性	±0.5%FS
再現性	±0.2%FS
パイプラインとバルブ	ステンレス鋼
最高使用圧力	0.45MPa
流量計コントローラ	デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー
標準真空ユニット (オプション)	
真空ポンプ	ロータリーベーン真空ポンプ
ポンプ流量	4L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	ピラニ/抵抗シリコン真空計
定格真空圧力	10Pa
高真空ユニット (オプション)	
真空ポンプ	ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ
ポンプ流量	4L/S+110L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	複合真空計
定格真空圧力	6×10 ⁻⁵ Pa

上記の仕様および設定はカスタマイズ可能です

いいえ。	説明	量
1	炉	1
2	石英管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱手袋	1
7	RFプラズマ源	1
8	正確なガス制御	1
9	バキュームユニット	1
10	取扱説明書	1

傾斜回転プラズマ化学蒸着 (Pecvd) 管状炉装置

商品番号: KT-PE16



前書き

精密な薄膜成膜を実現する傾斜回転式PECVD炉を紹介します。自動マッチングソース、PIDプログラマブル温度制御、高精度MFC質量流量計制御をお楽しみください。安全機能を内蔵しているので安心です。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	PE-1600-60
最大。温度	1600°C
一定の作業温度	1550°C
炉管材質	高純度Al2O3チューブ
炉管径	60mm
加熱ゾーンの長さ	2×300mm
チャンバー材質	日本製アルミナファイバー
発熱体	ニケイ化モリブデン
加熱速度	0~10°C/分
熱電対	Bタイプ
温度調節器	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1°C
RFプラズマユニット	
出力電力	5-500W ± 1%の安定性で調整可能
RF周波数	13.56MHz ± 0.005%の安定性
反射力	最大350W
マッチング	自動
ノイズ	
冷却	空冷。
ガス精密制御装置	
流量計	MFC質量流量計
ガスチャネル	4チャンネル

流量	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
直線性	±0.5%FS
再現性	±0.2%FS
パイプラインとバルブ	ステンレス鋼
最高使用圧力	0.45MPa
流量計コントローラ	デジタルノブコントローラ/タッチスクリーンコントローラ
標準真空ユニット (オプション)	
真空ポンプ	ロータリーベーン真空ポンプ
ポンプ流量	4L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	ピラニ/抵抗シリコン真空計
定格真空圧力	10Pa
高真空ユニット (オプション)	
真空ポンプ	ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ
ポンプ流量	4L/S+110L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	複合真空計
定格真空圧力	6×10 ⁻⁵ Pa
上記の仕様および設定はカスタマイズ可能です	

いいえ。	説明	量
1	炉	1
2	石英管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱手袋	1
7	RFプラズマ源	1
8	正確なガス制御	1
9	バキュームユニット	1
10	取扱説明書	1

プラズマ蒸着Pecvdコーティング機

商品番号: KT-PED



前書き

PECVD コーティング装置でコーティングプロセスをアップグレードします。

LED、パワー半導体、MEMSなどに最適です。低温で高品質の固体膜を堆積します。

[詳細を学ぶ](#)

サンプルホルダー	サイズ	1~6インチ
	回転速度	0-20rpm調整可能
	加熱温度	≤800°C
	制御精度	±0.5°C シマデン製PIDコントローラー
ガスパージ	流量計	マスフローメータコントローラ (MFC)
	チャンネル	4チャンネル
	冷却方法	循環水冷却
真空室	チャンバーサイズ	Φ500mm×550mm
	展望窓	バッフル付きフルビューポート
	チャンバー材質	316 ステンレス鋼
	扉の種類	フロントオープンタイプのドア
	キャップ材質	304 ステンレス鋼
	真空ポンプポート	CF200フランジ
	ガス導入口	φ6ピデオデッキコネクタ
プラズマパワー	ソースパワー	DC電源またはRF電源
	カップリングモード	誘導結合またはプレート容量性
	出力電力	500W-1000W
	バイアスパワー	500v
真空ポンプ	ブレポンプ	15L/Sベーン真空ポンプ
	ターボポンプポート	CF150/CF200 620L/S~1600L/S
	リリーフポート	KF25
	ポンプ速度	ベーンポンプ:15L/s、ターボポンプ:1200L/sまたは1600L/s
	真空度	≤5×10 ⁻⁵ Pa

真空センサー

電離真空計・抵抗真空計・膜計

システム	電力供給	AC220V/380 50Hz
	定格出力	5kW
	寸法	900mm×820mm×870mm
	重さ	200kg



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

